

JIS

半導体式微量ガス測定装置による 還元性微量ガス測定方法

JIS K 0315 : 2022

令和 4 年 12 月 20 日 制定

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本産業標準調査会標準第一部会 基盤技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	高 辻 利 之	国立研究開発法人産業技術総合研究所
(委員)	伊 藤 納 奈	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	柿 本 章 子	主婦連合会
	鈴 木 伸 哉	独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校
	高 橋 かより	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	田 原 江利子	王子ホールディングス株式会社
	安 井 清 一	東京理科大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：令和 4.12.20

官 報 掲 載 日：令和 4.12.20

原案作成協力者：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 松橋 隆治)

審議専門委員会：基盤技術専門委員会 (委員長 高辻 利之)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成協力者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 E-mail:jisc@meti.go.jp 又は FAX 03-3580-8625) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 測定方法の概要	3
5 測定装置の構成及び性能	3
5.1 測定装置の構成	3
5.2 測定装置の性能	5
6 微量ガス測定方法	5
6.1 使用準備	5
6.2 試料ガスの採取準備	6
6.3 試料ガスの採取	7
6.4 測定対象ガス種による試料ガスの取扱い上の注意事項	9
6.5 測定操作	9
6.6 測定装置の管理及び保管環境	10
7 測定装置の校正及び調整	10
7.1 校正用ガス	10
7.2 校正及び調整	11
7.3 校正結果報告書	12
8 測定結果の報告	13
解 説	14

まえがき

この規格は、産業標準化法に基づき、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本産業規格である。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

半導体式微量ガス測定装置による 還元性微量ガス測定方法

Method for measuring reducing trace gases by
semiconductor-type trace gas measuring equipment

1 適用範囲

この規格は、半導体式微量ガス測定装置（以下、測定装置という。）を使用して、主に大気、室内空気又は呼気に含まれる濃度範囲（通常、体積分率 1 ppb～100 ppm）の還元性微量ガス（以下、微量ガスという。）を、測定する方法について規定する。

この規格は、主に次の表 1 に示すガスに適用可能である。

表 1—主な測定対象ガス

分類	主な測定対象ガス
無機ガス	水素, 一酸化炭素
炭化水素	メタン, エタン, エチレン, イソブレン
芳香族炭化水素	トルエン, エチルベンゼン, キシレン, スチレン
アルコール	メタノール, エタノール
アルデヒド	アセトアルデヒド
ケトン	アセトン
硫化物	硫化水素, メタンチオール, 硫化ジメチル
アンモニア, アミン	アンモニア, トリメチルアミン
注記 メタン及びエタンの、濃度の上限の目安は体積分率 5 000 ppm である。	

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。この引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS Z 8103 計測用語

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、JIS Z 8103 による。